

Title (en)
QUANTUM WELL P-CHANNEL FIELD EFFECT TRANSISTOR, AND INTEGRATED CIRCUIT HAVING COMPLEMENTARY TRANSISTORS.

Title (de)
P-KANAL QUANTEN-TOPF-FELDEFFEKTTRANSISTOR UND INTEGRIERTE SCHALTUNG MIT KOMPLEMENTAEREN TRANSISTOREN.

Title (fr)
TRANSISTOR A EFFET DE CHAMP A CANAL P A PUITS QUANTIQUE, ET CIRCUIT INTEGRE A TRANSISTORS COMPLEMENTAIRES.

Publication
EP 0623244 A1 19941109 (FR)

Application
EP 93904106 A 19930121

Priority

- FR 9200668 A 19920122
- FR 9208985 A 19920721
- FR 9300061 W 19930121

Abstract (en)
[origin: WO9315523A1] A transistor comprising an Al_xGa_{1-x}As (or Al_xIn_{1-x}As) layer and a Ga_yIn_{1-y}As layer defining, at the latter layer, a quantum well having HH-type sub-bands. The thickness of the Ga_yIn_{1-y}As layer is selected so that when a negative voltage (VG) is applied to the gate, sub-bands HH₁, HH₂, HH₃,... occur in the quantum well and are separated by sufficient energy to ensure that the sub-bands corresponding to the highest effective masses M^{*}h// have a substantially lower hole density than sub-band HH₁, whereby a hole build-up condition is created in the quantum well and the transconductance of the component is correspondingly increased. This corresponds to a Ga_yIn_{1-y}As thickness of about 4-6 nm for 25-35 % indium, or 6-9 nm for 25-30 % indium. In order to further improve performance, a ternary structure such as Al_xGa_{1-x}As/Ga_yIn_{1-y}As/Al_zGa_{1-z}As, Al_xGa_{1-x}As/GaAs_wSb_{1-w}/Al_zGa_{1-z}As or Al_xGa_{1-x}As/Ga_yIn_{1-y}As_wSb_{1-w}/Al_zGa_{1-z}As may also be provided.

Abstract (fr)
Ce transistor comporte une couche Al_xGa_{1-x}As (ou Al_xIn_{1-x}As) et une couche Ga_yIn_{1-y}As définissant, au niveau de cette dernière couche, un puits quantique comportant des sous-bandes de type HH. Selon l'invention, l'épaisseur de la couche Ga_yIn_{1-y}As est choisie de manière que, lorsqu'une tension négative (VG) est appliquée à la grille, il apparaisse dans le puits quantique des sous-bandes HH₁, HH₂, HH₃, ... séparées par une énergie telle que les sous-bandes correspondant aux masses effectives m^{*}h// les plus élevées soient peuplées de trous en concentration notablement inférieure à celle des trous pendant la sous-bande HH₁, de manière à créer un régime d'accumulation de trous dans le puits quantique et accroître correspondamment la transconductance du composant. Ceci correspond, pour 25 à 35 % d'indium, à une épaisseur de Ga_yIn_{1-y}As comprise entre 4 et 6 nm environ ou, pour 25 à 30 % d'indium, à une épaisseur comprise entre 6 et 9 nm. On peut également prévoir, pour améliorer encore les performances, une structure ternaire telle que Al_xGa_{1-x}As/Ga_yIn_{1-y}As/Al_zGa_{1-z}As, Al_xGa_{1-x}As/GaAs_wSb_{1-w}/Al_zGa_{1-z}As ou Al_xGa_{1-x}As/Ga_yIn_{1-y}As_wSb_{1-w}/Al_zGa_{1-z}As.

IPC 1-7
H01L 29/76; H01L 27/06

IPC 8 full level
H01L 21/338 (2006.01); **H01L 27/06** (2006.01); **H01L 27/095** (2006.01); **H01L 29/06** (2006.01); **H01L 29/205** (2006.01); **H01L 29/66** (2006.01);
H01L 29/778 (2006.01); **H01L 29/80** (2006.01); **H01L 29/812** (2006.01)

CPC (source: EP)
H01L 27/0605 (2013.01); **H01L 29/205** (2013.01); **H01L 29/7783** (2013.01); **H01L 29/802** (2013.01)

Citation (search report)
See references of WO 9315523A1

Designated contracting state (EPC)
DE FR GB NL

DOCDB simple family (publication)
WO 9315523 A1 19930805; EP 0623244 A1 19941109; JP H07506461 A 19950713

DOCDB simple family (application)
FR 9300061 W 19930121; EP 93904106 A 19930121; JP 51297293 A 19930121